| Name: | |
|-----------|--|
| 1 1011101 | |

Klausur: Grundlagen der Elektronik WS 12/13

Kurzfragen ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 30 min)

- Gegeben ist das Bändermodell W(x) von Si. Markieren Sie für den Fall der n-Dotierung das Ferminiveau W_F . Skizzieren Sie die Zustandsdichten der Elektronen im Leitungsband und der Löcher im Valenzband D(W) in parabolischer Näherung, sowie bei Raumtemperatur die Fermi-Verteilung f(W) und die Elektronen- und Löcherkonzentrationen im Leitungs- bzw. Valenzband n(W), p(W) in den vorbereiteten Koordinatensystemen.
- Welche der Aussagen zu einem idealen pn-Übergang mit angelegter Spannung $U = (W_{Fn} W_{Fp})/q$ und zugehörigen Quasi-Fermi-Niveaus W_{Fn} und W_{Fp} sind zutreffend?
- 3) Welche der Aussagen zur Kapazität C einer pn-Diode mit abruptem Übergang, homogenen Dotierungen und Vorspannung U_0 zwischen p- und n-Bereich sind zutreffend?
- 4) Tragen Sie in die durchgezogene Strom-Spannungskennlinie eines *pn*-Übergangs die üblichen Arbeitspunkte in Form eines Kreuzes mit entsprechendem Buchstaben für folgende optoelektronischen Bauelemente ein:
- Welche der Aussagen zu dem gezeigten Bändermodell mit den Bandkanten W_V und W_L sowie den beiden Quasi-Ferminiveaus W_{Fn} und W_{Fp} für die Elektronen und Löcher sind richtig unter der Voraussetzung gleicher effektiver Zustandsdichten im Leitungs- und Valenzband?
- 6) Die Steilheit eines MOSFETs kann erhöht werden, wenn man
- 7) Um welche digitale Grundschaltung handelt es sich bei dem Bild rechts unten?
- 8) Welche der Aussagen zu einer MOS-Kapazität sind zutreffend?
- 9) Welche der Aussagen zum Bipolartransistor sind richtig?
- 10) Skizzieren Sie in dem vorbereiteten Diagramm den Konzentrationsverlauf der Minoritätsladungsträger in der neutralen Basis $(x_2 \text{ bis } x_3)$ eines npn-Transistors (Diffusionsdreieck). Vernachlässigen Sie die Variation der Verarmungszonenbreiten mit der Spannung. Markieren Sie die Verläufe mit dem Buchstaben der Teilaufgaben; U_{eb} : Emitter-Basis-Spannung und U_{cb} : Kollektor-Basis-Spannung.
 - a) $U_{eb}^{a} = 0; U_{cb}^{a} >> 0;$
 - b) $U_{eb}^{\ \ b} < U_{cb}^{\ \ b} = 0.$
 - c) Geben Sie die Minoritätsladungsträgerkonzentration $n_p(x_2)$ in Abhängigkeit von U_{eb} formelmäßig an.

| Name | ٠. | ., | | i | | ٠ | , | | | | | ., | |
|------|----|----|--|---|--|---|---|--|--|--|--|----|--|

Klausur: Grundlagen der Elektronik WS 12/13

lch erkläre mich damit einverstanden, dass meine Klausurnote gemeinsam mit meiner Matrikelnummer im Institut ausgehängt wird.

Braunschweig, den 27. 3. 2013

Aufgaben ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 2 Std.)

- Die spezifische Leitfähigkeit $\sigma(T)$ eines reinen p-Halbleiters mit einer Akzeptorkonzentration N_A und einer Donatorkonzentration $N_D = 0$ soll in den zwei Temperaturbereichen (1) und (2) für $n \ll p$ analysiert werden. Die effektiven Zustandsdichten N_L und N_V im Leitungs- und Valenzband sowie die Beweglichkeiten μ_n und μ_p der Elektronen und Löcher sollen jeweils gleich groß sein. Weiterhin gilt:
 - Ermitteln Sie ausgehend von Ladungsneutralität $(N_D^* + \rho = N_A^* + n)$ eine quadratische Gleichung für p, die als weitere Parameter nur noch p_0 und $N_{\rm A}$ enthält. Lösen Sie diese Gleichung näherungsweise für die Bereiche (1) und (2). Nutzen Sie:

$$N_{A}^{-} = \frac{N_{A}p_{0}}{p + p_{0}}; \ p_{0} = \frac{N_{V}}{4} \exp\left(\frac{W_{V} - W_{A}}{kT}\right); \ \text{Bereich(1):} \ \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p_{0}}{N_{A}}} < 1; \ \text{Bereich(2):} \ \frac{4}{p_{0}} < 1$$

b) Leiten Sie nun die Temperaturabhängigkeiten der Löcherkonzentration p(T) in den Bereichen (1) und (2) formelmäßig ab. Nutzen Sie das Ergebnis aus a):

$$p = \sqrt{\frac{N_{A}N_{0}}{4}} \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{344} \exp\left(-\frac{W_{A} - W_{V}}{2kT}\right) \text{ im Bereich (1) und } p = N_{A} \text{ im Bereich (2)}$$
sowie $N_{L}(T) = N_{V}(T) = N_{0} \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{3/2}$; $T_{0} = 300$ K

c) Ermitteln Sie anschließend die Temperaturabhängigkeiten der spezifischen Leitfähigkeit $\sigma(T)$ in den Bereichen (1) und (2). Die abgeleiteten Formeln sollen jeweils alle Temperaturabhängigkeiten explizit enthalten. Nutzen Sie:

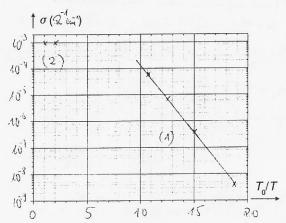
$$\begin{split} \sigma(T) &= \mathbf{q} \left[n(T) \mu_n(T) + p(T) \mu_p(T) \right] \text{ mit} \\ \mu_p(T) &= \mu_n(T) = \mu_1 \left(\frac{T_0}{T} \right)^{3/4} \text{ im Bereich (1) und } \mu_p(T) = \mu_n(T) = \mu_2 \text{ im Bereich (2)} \end{split}$$

gigkeit von T auf. Ergänzen Sie in der Tabelle auch die Werte von T_0/T .

| T(K) | 16 | 20 | 24 | 28 | 300 | 150 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| σ(1/Ωcm) | 4.10-9 | 4.10.7 | 7-10-6 | 6.10-5 | 10-3 | 10-3 |
| TJT | 188 | 15 | 12.5 | 10.7 | 1 | 2 |

Nutzen Sie die Vorlage und tragen Sie die Werte $\sigma(T/T)$ auf. Ergänzen Sie die Achsenbeschriftung. Markieren Sie die Bereiche (1) und (2) im Diagramm.

Formen Sie die in Bereich (1) vorliegende Temperaturabhängigkei $\sigma(T)$ so um, dass sich in Abhängigkeit von T_0/T eine lineare Funktion ergibt. Bestimmen Sie aus der Auftragung von $\sigma(T)$ die Ionisierungsenergie $W_{\rm A}$ - $W_{\rm Y}$ formel- und zahlenmäßig. (k = 8,62·10⁻⁵ eV/K).



Ma)
$$N_{0}^{+} + P = N_{0}^{-} + P_{0}^{-}$$
 $P = N_{0}^{-} = \frac{N_{0}}{4 \exp\left(\frac{N_{0}^{+} + N_{0}^{+}}{6 + r}\right) + 1} = \frac{N_{0}^{+} + P_{0}^{-}}{P + P_{0}^{-}} - \frac{P_{0}^{-}}{2} \frac{P_{0}^{-}}{2} \frac{P_{0}^{-}}{2} + N_{0}P_{0}^{-}$
 $P = N_{0}^{-} = \frac{N_{0}^{-} + N_{0}^{-}}{4 \exp\left(\frac{N_{0}^{+} + N_{0}^{+}}{4 + N_{0}^{-}}\right) + 1} = \frac{P_{0}^{-}}{P + P_{0}^{-}} - \frac{P_{0}^{-}}{2} \frac{P_{0}^{-}}{2} \frac{P_{0}^{-}}{2} + N_{0}P_{0}^{-}$
 $P = N_{0}^{-} = \frac{P_{0}^{-}}{4 \exp\left(\frac{N_{0}^{+} + N_{0}^{+}}{4 + N_{0}^{-}}\right) + 1} = \frac{P_{0}^{-}}{2} \frac{P_{0$

Wir betrachten in Abb. 2 eine ideale Metall Oxid Halbleiter Metall-Oxid-p-Halbleiter-Struktur in Abhängigkeit von der am Metall (Poly-Silizium-Gate) anliegenden Spannung U_g Gehen Sie, wie bei 300 K üblich, davon aus, dass die Dotierstoffe vollständig ionisiert sind und die beweglichen Ladungsträger in der Sperrschicht (0 & x & w) keine Rolle spielen.

p-Si

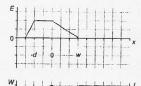
- -d 0 Ersatzschaltbild der Struktur beste- Abb. 2 hend aus Oxidkapazitätsbelag C_{ox} und Sperrschichtkapazitätsbelag C_s . Ermitteln Sie hieraus den Gesamtkapazitätsbelag der Struktur C bezogen auf Con in Abhängigkeit von w. Skizzieren Sie für niedrige Frequenzen den Verlauf von C/C_{ox} in Abhängigkeit von U_g . Markieren Sie die Bereiche der Anreicherung, Verarmung und Inversion sowie den Flachbandfall (C/C...)
- Bestimmen Sie die Bandaufwölbung W_i im Halbleiter in Abhängigkeit von der Dotierungskonzentration N_A und der Eigenleitungskonzentration n_i (Formel) mit:

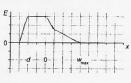
$$p = N_A = N_V \exp \left(\frac{W_V - W_F}{kT} \right)$$
; $n_i = N_V \exp \left(\frac{W_V - W_i}{kT} \right)$

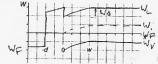
- Skizzieren Sie in der Vorlage die Verläufe der Raumladung, der elektrischen Feldstärke und der Bänder für den Fall des Einsetzens der schwachen Inversion (1) mit $W_s = W_i - W_F$ und der starken Inversion (2) mit $W_s = 2(W_i - W_F)$. Markieren Sie W_{s*} W_i , W_i , W_i and W_v .
- Bestimmen Sie die bei (2) erreichte maximale Ausdehnung der Sperrschicht wass mit:

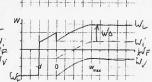
und daraus die minimale normierte Kapazität (C/Coc)min (Formeln und Zahlenwerte für beide Größen). Folgendende Daten sind gegeben: $N_{\rm A}=10^{15}~{\rm cm}^{-3};~d=50~{\rm nm};$ $\varepsilon_{\rm ax} = 2.96; \ \varepsilon_{\rm S} = 11.7; \ \varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \ {\rm As/(Vm)}; \ {\rm q} = 1.6 \cdot 10^{-19} \ {\rm C}; \ n_i = 10^{10} \ {\rm cm}^{-3};$ $k = 8.62 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}.$







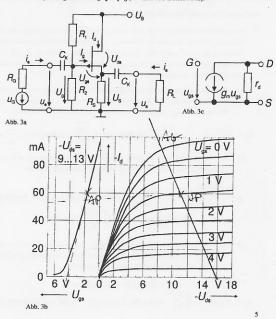




- 3) Die in Abb. 3a dargestellte Verstärkerschaltung wird bei einer Betriebsspannung U_B = -16 V betrieben. Als weitere Daten sind bekannt: R_O = 2 kΩ; R_L = 20 Ω; R_L = 100 kΩ; die Koppelkondensatoren C_K sind so dimensioniert, dass sie bei der Wechselstromanalyse als Kurzschlüsse betrachtet werden können.
 - a) Die Arbeitspunkteinstellung soll analysiert werden. Zeichnen Sie dazu das Gleichstromersatzschaltbild der Schaltung aus Abb. 3a incl. Beschriftung. Bestimmen Sie, für I_g = 0 und den Arbeitspunkt (AP: I_g = -60 mA; U_{ds} = -11 V) Zahlenwerte für U_{gr} U_S und U₂ = U_g swie R₃ und R₂. Verwenden Sie dazu die Kennlinien in Abb. 3b, in die Sie die Arbeitsgerade und die beiden Arbeitspunkte eintragen. Welcher Transistortyp liegt vor?
 - Für die Wechselstromanalyse zeichnen und beschriften Sie das Wechselstromersatzschaltbild der Gesamtschaltung unter Verwendung des FET-Ersatzschaltbildes in

Abb. 3c. Um welche Grundschaltung handelt es sich? Bestimmen Sie die Parameter g_m und r_a für den gegebenen Fall aus den Kennlinien in Abb. 3b (Formeln und Zahlenwerte).

ec) Berechnen Sie Eingangswiderstand $R_* = u_i I_i$, den Ausgangswiderstand $R_* = u_i I_i$, $(u_G = 0)$, die Leerlauf-Spannungsverstärkung $v_{u_L} = u_u I_u$, $(R_L = \infty)$ und die Spannungsverstärkung $v_* = u_i I_u$ (Formeln und Zahlenwerte).



20)
$$v_g = \frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{ox}} = \frac{1}{C_{ox}} =$$